電子顕微顕微鏡へ導入した光の点像分布関数

Point spread function of light introduced into an electron microscope

東工大物質理工¹, O(M2)安達良和¹、三宮工¹

Tokyo Tech.¹, O(M2)Yoshikazu Adachi¹, Takumi Sannomiya¹

E-mail: adachi.y.al@m.titech.ac.jp

1.背景

電子線励起による光放出を検出するカソード ルミネセンス法は、電子顕微鏡を用いることで、 光の分光情報を回折限界を超えたナノスケー ルで得ることができる。加速電子による励起で は、「白色」点光源を用いることができる一方 で、周波数選択ができないために、レーザー光 を用いたラマン分光のような計測はできてい ない。Amr A. E. Saleh らは、電子線とレーザー を同時に利用することで、ラマン光強度の増大 が起きることをシミュレーションで行った[1]。 これを実際に実験を行うことを目指し、我々は 電子線とレーザー光を同時に入射する実験系 を組み立てることに成功している。本発表では、 試料面上に当たるレーザービームの形状をシ ミュレーションで得た結果を報告する。

2.実験方法

走査型電子顕微鏡 (STEM) にレーザー光を入 射し、電子線とレーザー光をサンプルの同位置 に同時に照射する測定系を使用する (Fig.1)。 カソードルミネセンス法では、サンプルからの 発光を放物面鏡を用いてコリメートして電子 顕微鏡の鏡筒から取り出し検出するが、その逆 パスでレーザー光をサンプルに照射する。検出 にはレーザー光の波長をフィルターで減光し て分光器で計測を行う。

3.結果

シミュレーションで得たレーザービームの形 状を図2に示す。図2(a) は電子顕微鏡の放物 面鏡に向かって入射するレーザー光の絞り面



Fig.1 Experimental system in which electron beam and laser light are simultaneously incident. 上での形状を示す。平行に入射したレーザー光 は、その後、放物面鏡によって試料面上に集光 される。そのときの角度空間での様子を図 2(b) に示す。理想的には1点に集光するが、光の波 としての性質から実際には図2(c)のように 波紋状に広がる形をする。また、ビームの半径 や照射位置を様々変えた結果、入射するレーザ ー光の半径が小さく、照射位置が放物面鏡の中 心から遠ければ遠いほど、試料面上でのレーザ ースポットのサイズが大きくなることを確認 できた。



Fig.2 (a) Incident laser light shape. Beam center is 3mm above the sample, and beam radius is 0.5 mm. (b) Laser light shape converted to θ - ϕ plane. (c) Laser light shape on the sample plane.

参考文献

[1] Amr A. E. Saleh et al,

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.085406